# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

01-204228

(43) Date of publication of application: 16.08.1989

(51)Int.Cl.

G11B 7/08

(21)Application number : 63-028226

(71)Applicant: KONICA CORP

(22)Date of filing:

08.02.1988

(72)Inventor: HONDA HIDETOSHI

EGURO KOUICHI

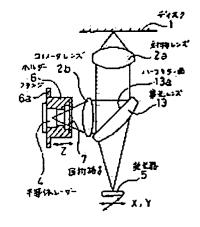
HIRABAYASHI HIDETOSHI

## (54) OPTICAL PICK-UP DEVICE

### (57)Abstract:

PURPOSE: To easily adjust focusing by fitting a semiconductor laser to a holder, adjusting the moving of the semiconductor laser in an optical direction, adjusting the moving of a photo-detector in an orthogonal direction to the optical axis and fixing the photo-detector after adjustment.

CONSTITUTION: Laser beams between an objective lens 2a and a collimator lens 2b are almost parallel but not completely parallel. Then, by moving a holder 6 in the optical axis direction, namely, in a Z direction, a semiconductor laser 4 is moved in the Z direction and the position of an optical spot on the optical axis to be formed in the positions of a disk 1 and a photo-detector 5 can be adjusted. The photo-detector 5 can be moved to



adjust in the orthogonal direction to the optical axis and fixed after the adjustment. Thus, the focus adjustment can be divided into the adjustment of the semiconductor laser 4 in the Z direction and the adjustment of the photo-detector 5 in X and Y directions. Then, an adjustment work goes to be extremely easy.

### **LEGAL STATUS**

えているので、半導体レーザー4は長時間使用しても温度上昇せず長期間安定に保持することができる。

#### (発明の効果)

本発明によれば以上説明したように構成されているので、光スポットの調整(無点調整)を半導体レーザーの光軸方向(Z方向)の調整と、受光器のX、Y方向の調整とに分割できるようになり、調整作業が極めて容易になり、しかも、余分のクリアランスがないので接着剤による固定をおこなが使うないの発生が少なくコストの低廉な光ピックアップ装置を提供することができる。

### 4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の第1 実施例を示す構成図、 第2 図は本発明の第2 実施例を示す構成図、 第3 図は本発明の第3 実施例を示す構成図、 第4 図は本発明の第4 実施例を示す構成図、 第5 図(a).(b)はホルダーとケーシングとの 関係を示す断面図、 第 6 図は上記実施例によって得られる光スポットパターンを示す図、

第 7 図(a).(b).(c)は従来の光ピックアップ 装置を示す構成図である。

1…ディスク

2 a … 対物レンズ

2 b … コリメーターレンズ

2 c .13… 集光レンズ 3 … ビームスブリッター 3 a .13a… ハーフミラー面 4 … 半導体レーザー

5 … 受光器

6 , 16… ホルダー

δ a … ァランジ

7 … 回折格子

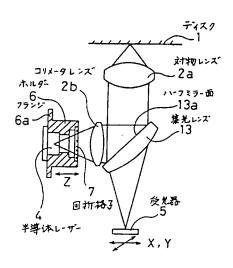
8 … ケーシング

8 a , 8 b … 取り付け穴

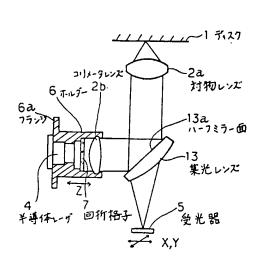
11…光スポット

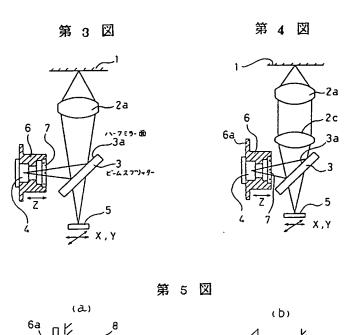
出願人 コニカ株式会社

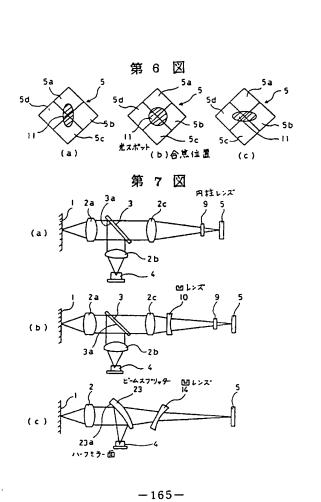
## 第 1 図



## 第 2 図







# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-204228

Int. Cl. 4

個発 明 者

識別記号

庁内整理番号

43公開 平成1年(1989)8月16日

G 11 B 7/08

A-7247-5D

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

②符 顧 昭63-28226

秀敏

22)出 顧 昭63(1988) 2月8日

本 多 秀 利 @発 明 者

東京都八王子市石川町2970番地 コニカ株式会社内

江 黒 孝 一 仰発 明 者

東京都八王子市石川町2970番地 コニカ株式会社内 東京都八王子市石川町2970番地 コニカ株式会社内

平 林 コニカ株式会社 の出 願 人

東京都新宿区西新宿1丁目26番2号

#### 1. 発明の名称

光ピックアップ装置

### 2. 特許請求の範囲

(1)発光 顔としての半導体レーザーから発した 光束を情報記録媒体上にスポット像として結像す る結像光学系と、その反射光を受光器へ導きフォ -- カス検出をする光学系から皮る光ピックアップ 装置において、前記半導体レーザーはホルダーに 取り付けて光軸方向に移動調整を可能とし、前記 受光器は光軸に対して直交方向に移動調整を可能 とし、調整後固定したことを特徴とする光ピック アップ装置。

(2)前記ホルダーには回折格子をも一体として 取り付けたことを特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の光ピックアップ装置。

(3)前記ホルダーは放熟効果を有する材質・形 状としたことを特徴とする特許請求の範囲第1項 又は第2項記載の光ピックアップ装置。

3. 発明の詳細な説明

### (産業上の利用分野)

本発明は、光学的ビデオディスク等の情報記録 媒体からの信号再生等に用いられる光ピックアッ プ装置、特に焦点検出手段を備えた光ピックアッ ブ装置に関する。

#### 〔従来の技術〕

光ピックアップ装置の魚点検出方式には種々の ものがある。そのなかに第7図(a)に示すような 非点収差方式がある。即ち半導体レーザー4から 発したレーザービームをコリメーターレンズ 2 b によって平行光とし、これをハーフミラー3aを 有するビームスプリッター3によって対物レンズ 2 aに向かって反射し対物レンズ2 a はレーザー ビームを情報記録媒体であるビディオディスク等 のディスク1上に集束させ、このディスク1から 反射した光束を対物レンズ2aによって再び平行 光とし、ビームスプリッター3を通過した平行光 を集光レンズ2cによって、4分割されたホトダ イオード等の受光案子からなる受光器5上にスポッ ト状に集束させる。この場合、集光レンズ2cと

受光器 5 との間には円柱レンズ 9 を挿入して非点 収. 差を発生させているので、上記集東光 (光スポット 11) は第 6 図に示すように合焦位置(b) ではほ ぼ円形に、ディスク 1 が合焦位置より遠く離れた 場合と近すぎた場合には(a) あるいは(c)のよう に互いに直交する楕円形になる。従って、受光器 5 の受光素子 5 a.5 cの出力の和と受光素子 5 b.5 d の和とを比較することによって合焦の判 断及び焦点合わせの自動制御を行うことができる。

第7図(b)に示す装置は第7図(a)に示す装置の集光レンズ2cと円柱レンズ9の間にさらに凹レンズ10を挿入したもので、集光レンズ2cと受光器5との間隔を長くして調整し易くすると共に、凹レンズ10を光軸方向及び光軸に直交する方向に移動させて焦点合わせあるいは基準調整を行うことができる。

第 7 図(c)に示す装置は第 7 図(a)に示す装置のビームスプリッター 3 の代わりに凹曲面のハーフミラー面 23aを有する凸レンズ状のビームスプリッター 23を設け、コリメーターレンズ 2 b と集

の 3 方向について 関整する、

(b)凹レンズ10の位置を 2 方向又は X, Y, 2 の 3 方向について調整する、

(c) 受光器 5 の位置を X . Y . Z の 3 方向に移動 して調整する、等の方法がある。

しかし、(a)の方法は微細な調整が必要で作業時間が長くなり、調整用のレンズを保持するホルダーと装置全体のケーシングに上記ホルダーを調整可能に取り付けるための加工を必要とするのでコストアップを招く等の問題点がある。

(b)の方法は(a)と同じく調整用のホルダーモの他を必要としコストアップとなる。

また(c)の方法は受光器 5 のホルダーとケーシングとの間に 調整を行う余裕(クリアランス)を設け、 X,Y,Z の 3 方向について 調整を行う必要がある。

(a),(b),(c)いずれの場合も3方向の調整を同時に行うのには特別な治具を必要としコストアップを招き、作業も難しい。また3方向の調整後接着剤等によって固定するのであるが、3方向の調

光レンズ 2 c を廃止したものである。このビームスプリッター 23と他の 1 枚の凹レンズ 14に 適当な個でなど 類きを与え、受光器 5 上でのコマ収差をキャンセルするようにしたものである。

かかる光ピックアップ装置では、正規の位置に 光ピックアップ装置があるときは、半導体レーザ 4 から発光したレーザー光は正規位置にあるディ スク1上に集束し、その反射光は受光器 5 上に第 6 図(b)の状態に結像する。しかし上記のいずれ の場合においても、装置を組み立てる際各部品の 寸法課差、取り付け位置課差等によって、ディス ク1上及び最終の受光器 5 上の光スポット位置の 光軸方向(2 方向)及び光軸に直交する 2 方向(X、 Y 方向)のズレが発生し、ディスク1に記録され た情報の読み取り性能が低下する。それで、この ズレを補正しなければならない。

(発明が解決しようとする問題点)

従来、上記光スポット位置のズレを補正(焦点調整)するには、

(a)円柱レンズ 9 の位置を Z 方向又は X , Y , Z

整を行うためにホルダーとケーシングの間のクリアランスを大きくしなければならないため、接着剤の環境の変化による伸縮及び経年変化等が起こり不安定である等の問題点があった。

本発明は、以上のような問題点を解決し、焦点調整が容易で、部品点数が少なく安価で、環境変化に強く経年変化の少ない光ピックアップ装置を提供ことを目的とする。

[問題点を解決するための手段]

上記目的は、発光環としての半導体レーザーから発した光束を情報記録媒体上にスポット後光器へて結像する結像光学系と、その反射光を登光とへ導きフォーカス後出をする光学系がら成る光ですった。
ないが一に取り付けて光軸方向に移動調整を可能とし、調整後固定したことを特徴とする光ピックアップ装置によって達成される。

(実施例)

以下図面によって本発明の実施例について説明

する.

第1図は本発明の第1実施例を示す構成図であ る。第7回と同一又は相当部分は同一符号を用い て丧示してあり、その詳細な説明は省略する。図 において、13はハーフミラー面13aを有する集光 レンズで、これを光軸に対して45度負けて設ける ことによって非点収差を発生させ、第 7 図(a)に おけるビームスプリッター3と円柱レンズ9を省 略することができる。6は例えばアルミニューム などの熱伝導の良好な材質からなり、その一端は 放熟用の幅の広いフランジ6aが形成されている ホルダーで、半導体レーザー4及び回折格子7を 保持するようになっていて、後述する焦点調整の 場合、半導体レーザー4及び回折格子7の光軸方 向の調整を同時に行うことができる。回折格子? は位相形の回折格子で特開昭 57-205833号公報に 開示されたトラッキングエラー信号を得る一方法 としてレーザービームを0次及び±1次の回折ビ - ムに分離するためのものである。この方法では レーザービームが3ピームになるため受光器は、

レンズ2 cを省略できる。また、平行平面板からなるビームスブリッター 3 が光軸に対して 45度に傾けて挿入してあるので非点収差を発生し円柱レンズ 9 を省略し、極めて簡素な構成とすることができる。

第4図は本発明の第4実施例を示す構成図で、ビームスブリッター3を集光レンズ2cと受光器5との間に設置して非点収差を発生させ、第7図(a)におけるコリメーターレンズ2bと円柱レンズ9を省略できるようにしたものである。

上記いずれの場合も半導体レーザー 4 及び回折格子 7 のホルダー 6 及び受光器 5 のホルダー 16は、第 5 図に示すようにケーシング 8 に取り付けられるようになっている。

第 5 図 (a)は半導体レーザー 4 のホルダー 6 とケーシング 8 との関係を示す断面図で、ホルダー 6 のケーシング 8 に嵌入する部分の外径はケーシング 8 の取り付け穴 8 a にスムースに嵌合できる大きさになっていて、半導体レーザー 4 と回折格子 7 を 2 方向に容易に調整可能であるが X , Y 方

受光器 5 の外に 2 個必要であるが本発明には直接 関係ないので省略してある。

対物レンズ2aとコリメーターレンズ2bの間のレーザービームはほぼ平行になっているが完全に平行ではなくて、ホルダー6を光軸方向(2方向)に移動することによって半導体レーザー4を 2方向に移動させ、ディスク1及び受光器5の位置にに形成される光スポットの光軸上の位置を調整できるようになっている。

第2図は本発明の第2の実施例を示す構成図で、 第1図におけるコリメーターレンズ2bをもホルダー6に装着したもので、対物レンズ2aとコリメーターレンズ2bとの間は完全な平行光ではなくほぼ平行光であるところから、ホルダー6を大きくZ方向に移動させることによって精度の良い調整がなされる。

第3図は本発明の第3実施例を示す構成図で、 レーザー光源を対物レンズ2aに対して有限距離 に設置した形式のものである。これによって第7 図(a)におけるコリメーターレンズ2b及び集光

向には無駄な遊びがないようになっている。従って、 調整後は接着剤等で安定した固定をすることができる。

第 5 図(b)は受光器 5 のホルダー16とケーシング8 との関係を示す断面図で、ホルダー16はそのフランジがケーシング 8 の取り付け面に当接して 2 方向には移動せず、取り付け穴 8 b に対し X、Y方向に移動できる充分なクリアランスを有している。従って、2 方向には殆ど移動するごとなく X、Y方向に調整可能である。調整後はネジ止め接着 利等で固定されるがフランジがケーシング 8 に当接しているので長期間にわたって狂いの生じることがない。

半導体レーザー 4 は60℃以上に保管されると劣化し易いものである。一方、光ピックアップ装置の本体は一般にブラスチック成型によるものの温をから、このため半導体レーザー 4 は使用中にその温度があった。本発明によるホルダー 6 は前述のように熱伝導性が良好な放熱用のフランジ 6 a を備